

Сведения о ведущей организации

1.	Полное наименование организации	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
2.	Сокращенное наименование организации	МГТУ им. Н.Э. Баумана
3.	Ведомственная принадлежность	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
4.	Место нахождения	г. Москва
5.	Почтовый адрес организации с указанием индекса	105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, строение 1
6.	Телефон с указанием кода города	Тел. +7 499 263-63-91
7.	Адрес электронной почты	E-mail: bauman@bmstu.ru
8.	Адрес официального сайта в сети «Интернет»	https://bmstu.ru
9.	Руководитель организации	Гордин Михаил Валерьевич
10.	Уполномоченный	Дроговоз Павел Анатольевич
11.	Должность	Проректор по науке и стратегическим коммуникациям
12.	Ученая степень	Доктор экономических наук
13.	Ученое звание	Профессор
14.	Список основных публикаций работников ведущей организации по тематике диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 10 публикаций)	<p>1. Panfilov Y.V., Nesterov S.B., Kolesnik L.L., Sidorova S.V., Tsvetkov Y. B., Modern trends of student training on vacuum technic and technology, Journal of Physics: Conference Series, V. 1313. №012043., 2019, 0.55, 10.1088/1742-6596/1313/1/012043</p> <p>2. Aleksandr S. Baburin, Alexander M. Merzlikin, Alexander V. Baryshev, Ilya A. Ryzhikov, Yuri V. Panfilov, Rodionov I. A., Silver-based plasmonics: golden material platform and application challenges, OPTICAL MATERIALS EXPRESS, V. 9. I. 2. P. 611-642., 2019, 2.673, DOI:10.1364/OME.9.000611</p> <p>3. Zhuo Y., Liang M., Moiseev K.M., Kolesnik L.L., Panfilov Y.V., Possibilities of the Electron-Beam Machine LUCH for Dimensional Microprocessing of Glass and Ceramic Materials, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, V. 781. I. 1. Art. no. 012014, 2020, 0.51, DOI:10.1088/1757-899X/781/1/012014</p> <p>4. Panfilov Y.V., Rodionov I.A., Ryzhikov I.A., Baburin A.S., Moskalev D.O., Lotkov E.S.,</p>

		<p>Ultrathin film deposition for nanoelectronic device manufacturing, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, V. 781. I. 1. Art. no. 012021., 2020, 0.51, DOI: 10.1088/1757-899X/781/1/012021</p> <p>5. Panfilov, Y.V., Kolesnik, L.L., Gurov, A.V, Thin film coatings material particles creation by pulsed methods in vacuum, Journal of Physics: Conference Series, V. 2059. I. 1. Art. No 012017., 2021, 0.55, 10.1088/1742-6596/2059/1/012017</p> <p>6. Каракулов Р.А., Панфилов Ю.В., Ильин В.Н., Повышение адгезионной прочности металлизации диэлектриков перед пайкой с арматурой СВЧ-приборов, Упрочняющие технологии и покрытия, Т. 14. № 8 (164). С. 378-381., 2018, 0.557</p> <p>7. Нелюб В.А., Федоров С.Ю., Бурченкова Т.Д., Панфилов Ю.В., Моделирование тепловых нагрузок, возникающих при воздействии электрических полей на углеродные ленты с медным покрытием, Современные наукоемкие технологии, № 7. – С. 65-69, 2019, 0.382</p> <p>8. Бабурин А.С., Панфилов Ю.В., Родионов И.А., Цветков Ю.Б., Приборные применения плазмонных эффектов, Приборы, № 5 (240), С. 45-48, 2020, 0.147</p> <p>9. Панфилов Ю.В., Цветков Ю.Б., Современная контактная литография – ключевой процесс микроэлектронного приборостроения, Приборы, №1 (235), С. 46-53, 2020, 0.17</p> <p>10. Левченко В.А., Панфилов Ю.В., Упрочняющие покрытия на инструменте, Упрочняющие технологии и покрытия, Т. 16. № 5 (185). С. 234-240., 2020, 0.342</p>
--	--	--

Проректор по науке и
стратегическим коммуникациям



П.А. Дроговоз